

Nuestras instalaciones únicas están disponibles para los centros de investigación públicos y privados, así como para las empresas, que encontrarán en el equipamiento del LMA, una capacidad única de investigación y desarrollo tecnológico disponible en muy pocos centros de investigación a nivel mundial.

A continuación puede encontrar las instalaciones disponibles en nuestro centro, así como qué tipo de información se puede obtener con cada equipo. Además, un cuidadoso diseño de experimentos combinados en los diferentes instrumentos del LMA le proporcionará una visión completa de la morfología, composición y propiedades de su muestra.

### Área de Microfabricación: Dual Beam y Microcaracterización: SEM, XPS y XRD



Cryogenic Dual Beam Nova 200



Equipos de Doble Haz (Dual Beam) Helios Nanolab 600 y 650



Microscopio electrónico de barrido ambiental SEM-Quanta FEG-250, ESEM



Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo CSEM-FEG INSPECT F50



Difractómetro de rayos X de alta resolución Bruker D8 Advance: HR-XRD y XRR



Espectrómetro de fotoelectrones de rayos-X (XPS-AES) modelo Kratos AXIS UltraDLL

---

## Área de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) Area

---



TITAN Imagen de alta resolución (High-Base): FEI TITAN<sup>3</sup>



TITAN analítico (Low-base): FEI TITAN Low-base

---



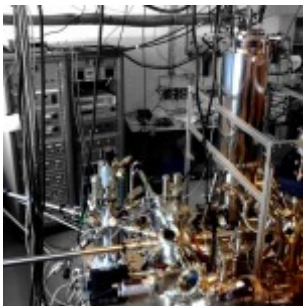
Microscopio Electrónico de Transmisión Tecnai F30



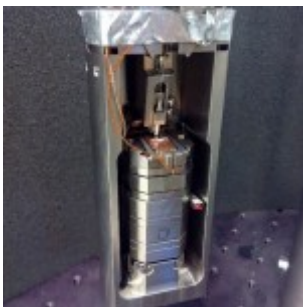
Servicio de Preparación de Muestras para el TEM

---

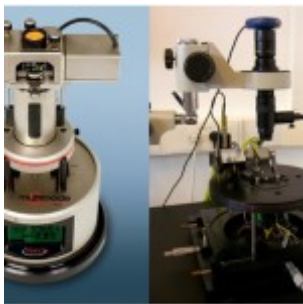
### Scanning Probe Microscopy (SPM) Area



Microscopios de barrido de sonda (SPM) a bajas temperaturas (LT) y ultra alto vacío (UHV-LT)



Laboratorio de Microscopia de Sonda Local en altos campos magnéticos y bajas temperaturas



Microscopía de sonda local (SPM) en condiciones ambientales

---